

表1-1. 装置等の利用負担金表

(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による利用、中小企業(備考5)のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用)

装置群	装置等			利用料金(消費税込)		設置場所
	No.	機器名	メーカー名	(一日当り)	(一時間当り)	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	162,648円	20,358円	イロールーム
	A2	露光装置(ステッパー)	(株)ニコン	65,070円	8,154円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg Instruments社製)	44,172円	5,562円	イロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	25,110円	3,186円	イロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	17,550円	2,214円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	2,700円	378円	イロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	9,558円	1,242円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	4,860円	648円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	6,210円	810円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	4,860円	648円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	9,072円	1,134円	イロールーム
	A12	ウエハ汚染計測装置	アジレント・テクノロジー(株)	15,120円	1,890円	イロールーム
	A13	液滴吐出描画装置	(株)SIJテクノロジー	6,642円	864円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	6,480円	810円	イロールーム
	A15	大面積超高精度電子線描画装置	(株)アドバンテスト	214,704円	26,892円	加工・評価室 (クリーンルーム)
A51	A51	E B露光装置	(株)東京テクノロジー	5,940円	756円	桂クリーンルーム
	A52	ステッパ	(株)大日本科研	57,564円	7,236円	桂クリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	26,568円	3,348円	桂クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	4,158円	540円	桂クリーンルーム
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置(仕様A)	キャノンアネルバ(株)	24,894円	3,132円	加工・評価室
	B2	多元スパッタ装置(仕様B)	キャノンアネルバ(株)	23,652円	2,970円	加工・評価室
	B3	電子線蒸着装置	キャノンアネルバ(株)	19,494円	2,484円	クリーンルーム1
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	3,834円	486円	加工・評価室
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	39,528円	4,968円	クリーンルーム1
	B6	集束イオンビーム/走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	79,650円	9,990円	加工・評価室
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	5,778円	756円	クリーンルーム2
	B8	深掘りドライエッチング装置	サムコ(株)	32,454円	4,104円	クリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	32,508円	4,104円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	5,562円	702円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	22,302円	2,808円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	26,028円	3,294円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	13,122円	1,674円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	(株)東京インスツルメンツ	21,870円	2,754円	加工・評価室
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	20,736円	2,592円	加工・評価室
	B16	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	27,810円	3,510円	イロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	25,272円	3,186円	イロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	(株)東京精密	41,742円	5,238円	加工・評価室
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	3,780円	486円	加工・評価室
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	3,240円	432円	加工・評価室
	B21	紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	1,458円	216円	加工・評価室
	B22	エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	756円	108円	加工・評価室
	B23	ウエッジワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	1,620円	216円	加工・評価室BF
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	1,674円	216円	加工・評価室BF
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	1,512円	216円	加工・評価室BF
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	6,642円	864円	イロールーム
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	6,264円	810円	イロールーム	
B51	パルレン成膜装置	日本パルレン合同会社	2,214円	324円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	3,078円	432円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	1,998円	270円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	28,080円	3,510円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	1,080円	162円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	3,510円	486円	桂クリーンルーム	

表1-1. 装置等の利用負担金表(続き)

(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による利用、中小企業(備考5)のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用)

装置群	No.	装置等		利用料金(消費税込)		設置場所
		機器名	メーカー名	(一日当り)	(一時間当り)	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	29,700円	3,726円	加工・評価室
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	41,364円	5,184円	加工・評価室
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	15,822円	1,998円	加工・評価室
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	14,364円	1,836円	加工・評価室
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	15,390円	1,944円	加工・評価室
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	6,156円	810円	加工・評価室
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	12,582円	1,620円	加工・評価室
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	9,558円	1,242円	加工・評価室
	C10	X線回折装置	(株)リガク	16,740円	2,106円	加工・評価室
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	10,206円	1,296円	クリーンルーム2
	C12	三次元粒子トラッキングシステム	JPKインスツルメンツ	12,042円	1,512円	加工・評価室
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	6,588円	864円	加工・評価室
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	8,802円	1,134円	加工・評価室
	C15	触針式段差計 1	(株)アルバック	2,862円	378円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計 2	(株)アルバック	2,862円	378円	加工・評価室
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	17,442円	2,214円	加工・評価室BF
	C17	プローバ	(株)日本マイクロニクス	3,888円	486円	加工・評価室BF
	C18	真空プローバ	カスケード・マイクロテック(株)	15,174円	1,944円	加工・評価室BF
	C19	パワーデバイスアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	4,914円	648円	加工・評価室BF
	C20	インピーダンスアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	2,052円	270円	加工・評価室BF
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	6,480円	810円	加工・評価室BF
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	6,480円	810円	加工・評価室BF
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	6,480円	810円	加工・評価室BF
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	2,376円	324円	クリーンルーム1
	C26	マニュアルプローバ	(株)アポロウェーブ	2,160円	270円	加工・評価室BF
	C27	RFプローブキット	(株)アポロウェーブ	864円	108円	加工・評価室BF
	C28	ネットワークアナライザ	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	2,160円	270円	加工・評価室BF
	C29	半導体パラメータアナライザ	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	2,160円	270円	加工・評価室BF

備考

- 上記表中の利用料は、1日又は1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、設置場所に応じて表-4の基本料金を負担いただきます。ただし、ナノテクノロジープラットフォーム事業での利用者は基本料金が免除されます。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

表1-2. 装置等の利用負担金表
(中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用)

装置群	装置等			利用料金(消費税込)		設置場所
	No.	機器名	メーカー名	(一日当り)	(一時間当り)	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	260,237円	32,573円	イロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	104,112円	13,047円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg Instruments社)	70,676円	8,900円	イロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	40,176円	5,098円	イロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	28,080円	3,543円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	4,320円	605円	イロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	15,293円	1,988円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	7,776円	1,037円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	9,936円	1,296円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	7,776円	1,037円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	14,516円	1,815円	イロールーム
	A12	ウエハ汚染計測装置	アジレント・テクノロジー(株)	24,192円	3,024円	イロールーム
	A13	液滴吐出描画装置	(株)SIJテクノロジー	10,628円	1,383円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	10,368円	1,296円	イロールーム
	A15	大面積超高精度電子線描画装置	(株)アドバンテスト	343,548円	43,092円	加工・評価室 (クリーンルーム)
A51	A51	E B露光装置	(株)東京テクノロジー	9,504円	1,210円	桂クリーンルーム
	A52	ステッパ	(株)大日本科研	92,103円	11,578円	桂クリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	42,509円	5,357円	桂クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	6,653円	864円	桂クリーンルーム
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	キャノンアネルバ(株)	39,831円	5,012円	加工・評価室
	B2	多元スパッタ装置 (仕様B)	キャノンアネルバ(株)	37,844円	4,752円	加工・評価室
	B3	電子線蒸着装置	キャノンアネルバ(株)	31,191円	3,975円	クリーンルーム1
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	6,135円	778円	加工・評価室
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	63,245円	7,949円	クリーンルーム1
	B6	集束イオンビーム/走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	127,440円	15,984円	加工・評価室
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	9,245円	1,210円	クリーンルーム2
	B8	深掘りドライエッチング装置	サムコ(株)	51,927円	6,567円	クリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	52,013円	6,567円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	8,900円	1,124円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	35,684円	4,493円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	41,645円	5,271円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	20,996円	2,679円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	(株)東京インストルメンツ	34,992円	4,407円	加工・評価室
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	33,178円	4,148円	加工・評価室
	B16	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	44,496円	5,616円	イロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	40,436円	5,098円	イロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	(株)東京精密	66,788円	8,381円	加工・評価室
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	6,048円	778円	加工・評価室
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	5,184円	692円	加工・評価室
	B21	紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	2,333円	346円	加工・評価室
	B22	エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	1,210円	173円	加工・評価室
	B23	ウエッジワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	2,592円	346円	加工・評価室BF
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	2,679円	346円	加工・評価室BF
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	2,420円	346円	加工・評価室BF
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	10,628円	1,383円	イロールーム
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	10,023円	1,296円	イロールーム	
B51	パルレン成膜装置	日本パルレン合同会社	3,543円	519円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	4,925円	692円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	3,197円	432円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	44,928円	5,616円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	1,728円	260円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	5,616円	778円	桂クリーンルーム	

表1-2. 装置等の利用負担金表(続き)
 (中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用)

装置群	No.	装置等		利用料金(消費税込)		設置場所
		機器名	メーカー名	(一日当り)	(一時間当り)	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	47,520円	5,962円	加工・評価室
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	66,183円	8,295円	加工・評価室
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	25,316円	3,197円	加工・評価室
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	22,983円	2,938円	加工・評価室
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	24,624円	3,111円	加工・評価室
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	9,850円	1,296円	加工・評価室
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	20,132円	2,592円	加工・評価室
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	15,293円	1,988円	加工・評価室
	C10	X線回折装置	(株)リガク	26,784円	3,370円	加工・評価室
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	16,330円	2,074円	クリーンルーム2
	C12	三次元粒子トラッキングシステム	JPKインスツルメンツ	19,268円	2,420円	加工・評価室
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	10,541円	1,383円	加工・評価室
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	14,084円	1,815円	加工・評価室
	C15	触針式段差計 1	(株)アルバック	4,580円	605円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計 2	(株)アルバック	4,580円	605円	加工・評価室
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	27,908円	3,543円	加工・評価室BF
	C17	プローバ	(株)日本マイクロニクス	6,221円	778円	加工・評価室BF
	C18	真空プローバ	カスケード・マイクロテック(株)	24,279円	3,111円	加工・評価室BF
	C19	パワーデバイスアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	7,863円	1,037円	加工・評価室BF
	C20	インピーダンスアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	3,284円	432円	加工・評価室BF
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	10,368円	1,296円	加工・評価室BF
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	10,368円	1,296円	加工・評価室BF
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	10,368円	1,296円	加工・評価室BF
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	3,802円	519円	クリーンルーム1
	C26	マニュアルプローバ	(株)アポロウェーブ	3,456円	432円	加工・評価室BF
	C27	RFプローブキット	(株)アポロウェーブ	1,383円	173円	加工・評価室BF
	C28	ネットワークアナライザ	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	3,456円	432円	加工・評価室BF
	C29	半導体パラメータアナライザ	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	3,456円	432円	加工・評価室BF

備考

- 1 上記表中の利用料は、1日又は1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
- 2 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 3 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

表1-3. 装置等の利用負担金表

(ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用)

装置群	No.	装置等		利用料金(消費税込)		設置場所
		機器名	メーカー名	(一日当り)	(一時間当り)	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	325,296円	40,716円	イロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	130,140円	16,308円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg Instruments社)	88,344円	11,124円	イロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	50,220円	6,372円	イロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	35,100円	4,428円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	5,400円	756円	イロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	19,116円	2,484円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	9,720円	1,296円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	12,420円	1,620円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	9,720円	1,296円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	18,144円	2,268円	イロールーム
	A12	ウエハ汚染計測装置	アジレント・テクノロジー(株)	30,240円	3,780円	イロールーム
	A13	液滴吐出描画装置	(株)SIJテクノロジー	13,284円	1,728円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	12,960円	1,620円	イロールーム
	A15	大面積超高精度電子線描画装置	(株)アドバンテスト	429,408円	53,784円	加工・評価室 (クリーンルーム)
A51	A51	E B 露光装置	(株)東京テクノロジー	11,880円	1,512円	桂クリーンルーム
	A52	ステッパ	(株)大日本科研	115,128円	14,472円	桂クリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	53,136円	6,696円	桂クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	8,316円	1,080円	桂クリーンルーム
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	キャノンアネルバ(株)	49,788円	6,264円	加工・評価室
	B2	多元スパッタ装置 (仕様B)	キャノンアネルバ(株)	47,304円	5,940円	加工・評価室
	B3	電子線蒸着装置	キャノンアネルバ(株)	38,988円	4,968円	クリーンルーム1
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	7,668円	972円	加工・評価室
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	79,056円	9,936円	クリーンルーム1
	B6	集束イオンビーム/走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	159,300円	19,980円	加工・評価室
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	11,556円	1,512円	クリーンルーム2
	B8	深掘りドライエッチング装置	サムコ(株)	64,908円	8,208円	クリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	65,016円	8,208円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	11,124円	1,404円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	44,604円	5,616円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	52,056円	6,588円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	26,244円	3,348円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	(株)東京インストルメンツ	43,740円	5,508円	加工・評価室
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	41,472円	5,184円	加工・評価室
	B16	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	55,620円	7,020円	イロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	50,544円	6,372円	イロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	(株)東京精密	83,484円	10,476円	加工・評価室
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	7,560円	972円	加工・評価室
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	6,480円	864円	加工・評価室
	B21	紫外線照射装置	(株)テクビジョン	2,916円	432円	加工・評価室
	B22	エキスパンド装置	(株)テクビジョン	1,512円	216円	加工・評価室
	B23	ウエッジワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	3,240円	432円	加工・評価室BF
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	3,348円	432円	加工・評価室BF
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株) (ウエスト・ボンダ社)	3,024円	432円	加工・評価室BF
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	13,284円	1,728円	イロールーム
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	12,528円	1,620円	イロールーム	
B51	パルレン成膜装置	日本パルレン合同会社	4,428円	648円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	6,156円	864円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	3,996円	540円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	56,160円	7,020円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	2,160円	324円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	7,020円	972円	桂クリーンルーム	

表1-3. 装置等の利用負担金表(続き)
(ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用)

装置群	No.	装置等		利用料金(消費税込)		設置場所
		機器名	メーカー名	(一日当り)	(一時間当り)	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	59,400円	7,452円	加工・評価室
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	82,728円	10,368円	加工・評価室
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	31,644円	3,996円	加工・評価室
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	28,728円	3,672円	加工・評価室
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	30,780円	3,888円	加工・評価室
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	12,312円	1,620円	加工・評価室
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	25,164円	3,240円	加工・評価室
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	19,116円	2,484円	加工・評価室
	C10	X線回折装置	(株)リガク	33,480円	4,212円	加工・評価室
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	20,412円	2,592円	クリーンルーム2
	C12	三次元粒子トラッキングシステム	JPKインスツルメンツ	24,084円	3,024円	加工・評価室
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	13,176円	1,728円	加工・評価室
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	17,604円	2,268円	加工・評価室
	C15	触針式段差計 1	(株)アルバック	5,724円	756円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計 2	(株)アルバック	5,724円	756円	加工・評価室
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	34,884円	4,428円	加工・評価室BF
	C17	プローバ	(株)日本マイクロニクス	7,776円	972円	加工・評価室BF
	C18	真空プローバ	カスケード・マイクロテック(株)	30,348円	3,888円	加工・評価室BF
	C19	パワーデバイスアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	9,828円	1,296円	加工・評価室BF
	C20	インピーダンスアナライザ	アジレント・テクノロジー(株)	4,104円	540円	加工・評価室BF
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	12,960円	1,620円	加工・評価室BF
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	12,960円	1,620円	加工・評価室BF
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	12,960円	1,620円	加工・評価室BF
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	4,752円	648円	クリーンルーム1
	C26	マニュアルプローバ	(株)アポロウェーブ	4,320円	540円	加工・評価室BF
	C27	RFプローブキット	(株)アポロウェーブ	1,728円	216円	加工・評価室BF
	C28	ネットワークアナライザ	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	4,320円	540円	加工・評価室BF
	C29	半導体パラメータアナライザ	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	4,320円	540円	加工・評価室BF

備考

- 1 上記表中の利用料は、1日又は1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
- 2 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 3 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 4 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、設置場所に応じて表-4の基本料金を負担いただきます。

表 2. 装置等の利用負担金の上限

利用者種別	利用料（1テーマ当たり）
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	324万円
上記以外の者	1,080万円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。

表 3. 技術代行における技術料（技術代行はナノテクノロジープラットフォーム事業での利用に限ります）

1時間当たり	1日当たり
2,700円	21,600円

備考

- 1 上記表中の料金は、1日又は1時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
- 2 1時間未満の技術代行及び1時間を超える技術代行に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

表 4. 基本料金表

区 分	利用料（1日当たり）
クリーンルーム（イエロールームを含む）に設置された装置等を利用する場合	3,348円
加工・評価室（加工・評価室、加工・評価室BF）に設置された装置等を利用する場合	1,188円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1日当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに実験室等の利用日数を乗じた金額を1人当たりの基本料金とします。
- 2 複数の者が実験室等を利用する場合については、上記1の1人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。
- 3 1人で同一日にクリーンルーム及び加工・評価室を併せて利用する場合については、クリーンルームの料金を基本料金とします。
- 4 ナノテクノロジープラットフォーム事業での利用者は基本料金が免除されます。

表 5. サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ（専有部分） セミナー室	165円	21円

備考

- 1 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。
- 2 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとします。
- 3 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表 6. 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
利用開始日の8日前から30日前まで	利用負担金の額の50%
利用開始日当日から7日前まで	利用負担金の額の100%

備考

- 1 利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点口利用負担金内規第2条第2項、第3項及び第4項に基づき算出した額とします。
- 2 キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。